

ИЗВЕСТИЯ
ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО
ИНСТИТУТА имени С. М. КИРОВА

Том 162

1967

О МЕТОДИКЕ ПОЛУЧЕНИЯ КИНЕТИЧЕСКИХ КРИВЫХ
НАКОПЛЕНИЯ ЦЕНТРОВ ОКРАСКИ ПОД ДЕЙСТВИЕМ
РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В МИКРОСЛОЯХ
ЩЕЛОЧНОГАЛОИДНЫХ МОНОКРИСТАЛЛОВ

Л. И. РОЩИНА

(Представлена научным семинаром научно-исследовательского института физики твердого тела)

В радиационной физике твердого тела одним из важных методов исследования является кинетика накопления центров окраски, образованных действием излучения. Радиационная кинетика изучает закономерности изменения свойств твердых тел в зависимости от дозы, интенсивности и вида излучения и позволяет получить важную информацию о микропроцессах, лежащих в основе этого радиационного изменения свойств. Однако количественное исследование концентрации центров окраски, возникающих под действием рентгеновского излучения в щелочногалоидных кристаллах, затруднено из-за неравномерного распределения окраски по глубине кристалла. Эта неравномерность окраски обусловлена ослаблением пучка рентгеновых лучей с увеличением толщины образца. Наибольшую окраску имеет лицевая сторона кристалла, а градиент концентрации центров окраски зависит от энергии и жесткости падающих рентгеновых лучей и от поглощающей способности кристалла.

До сих пор во всех исследованиях кинетики радиационного накопления центров окраски оптическое измерение концентрации F -центров проводилось по направлению, совпадающему с направлением облучения, что давало интегральную величину концентрации центров по толщине. Это вносит настолько большую погрешность при количественном исследовании кинетики накопления центров окраски, что в ряде случаев исключает возможность определения важных радиационных параметров с помощью кинетической кривой накопления центров окраски.

Однако неоднородность окраски по глубине можно было бы учесть, проводя оптические измерения по направлению, перпендикулярному направлению облучения. Подобное исследование было впервые проведено Мадором и др. [1] для кристаллов NaCl и LiF . Авторами этой работы интересовало распределение окраски по глубине кристаллов и кинетика накопления F - и M -центров в разных участках образца. Мадору и др. удалось промерить спектр поглощения облученного кристалла только на расстоянии 1—2 мм от края кристалла. При оптических измерениях ширина пучка световых лучей составляла 0,4 мм. Это вносило определенную погрешность в измерения концентрации центров окраски, так как имеется значительная неравномерность в их распределении в сегменте размером 0,4 мм.

Таким образом, методика, предложенная Мадором, не могла быть использована для кристаллов с большой поглощающей способностью, например, KCl, KBr, KJ. С другой стороны, кинетическая кривая накопления F-центров в KCl имеет наиболее сложный вид, что обеспечивает получение наибольшей информации из этой кривой [2]. Вследствие этого нам потребовалось существенно усовершенствовать методику измерения спектров поглощения в микрослоях.

Схема установки представлена на рис. 1.

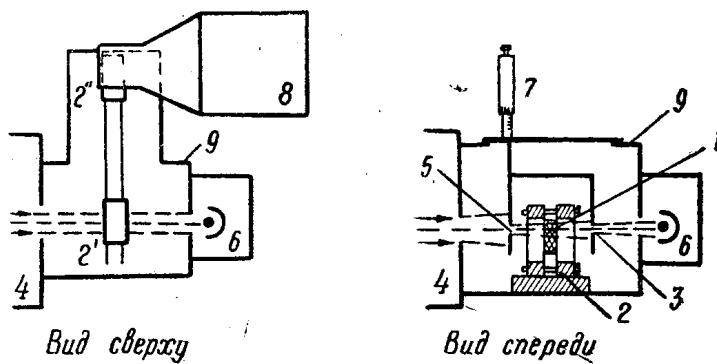


Рис. 1. Схема установки:
1 — кристалл, 2 — кристаллодержатель ($2'$ — положение держателя при фотометрировании, $2''$ — при облучении), 3 — щель шириной 30μ , 4 — спектрофотометр СФ-4, 5 — щель шириной $0,5 \text{ мм}$, 6 — фотоэлемент, 7 — микрометр, 8 — рентгеновская установка УРС-55А, 9 — камера.

Кристалл 1 устанавливается в держателе 2, позволяющем настроить край кристалла так, чтобы: а) он был параллелен щели в 30μ 3, б) максимально уменьшить эффект отражения от торцовой поверхности кристалла. При оптических измерениях кристаллодержатель находится в положении $2'$. При этом световой пучок из щели спектрофотометра СФ-4 (4) попадает на щель 5, проходит через кристалл 1, через щель 3 и попадает на фотоэлемент 6. Из светового потока, проходящего через кристалл, щелью 3 вырезается узкий пучок лучей шириной 30μ . Щель 5 шириной $0,5 \text{ мм}$ ограничивает световой поток, падающий на кристалл, тем самым уменьшается высвечивание центров окраски. При оптических измерениях кристалл неподвижен, а щели 3 и 5 перемещаются с помощью микрометра 7. Это позволяет фотометрировать образец через 10μ по всей глубине кристалла. Воспроизводимость гарантируется в пределах $\pm 5 \mu$. При облучении кристаллодержатель находится в положении $2''$ под рентгеновской установкой УРС-55А 8. Рентгеновы лучи направлены вниз. Облучение образца производится в торец. Расстояние от окна трубы до кристалла 15 мм . При облучении и фотометрировании кристаллодержатель с образцом находятся в камере 9, полностью защищающей образец от проникновения света. Время между прекращением излучения и фотометрированием может быть уменьшено до нескольких секунд.

В зависимости от жесткости рентгеновых лучей распределение окраски по глубине кристалла различно. На рис. 2, а приведены кривые уменьшения концентрации F-центров от толщины кристалла KCl, облученного рентгеновыми лучами от трубы с медным (1) и молибденовым (2 анодом).

(Режим работы: $14 \text{ ма}, 42 \text{ кв}$). Более мягкие рентгеновы лучи от трубы с Si-анодом сильнее поглощаются в первых слоях кристалла

KCl, а, следовательно, уменьшение концентрации F -центров по глубине более резкое, чем для кристалла, облученного лучами от трубы с Mo-анодом.

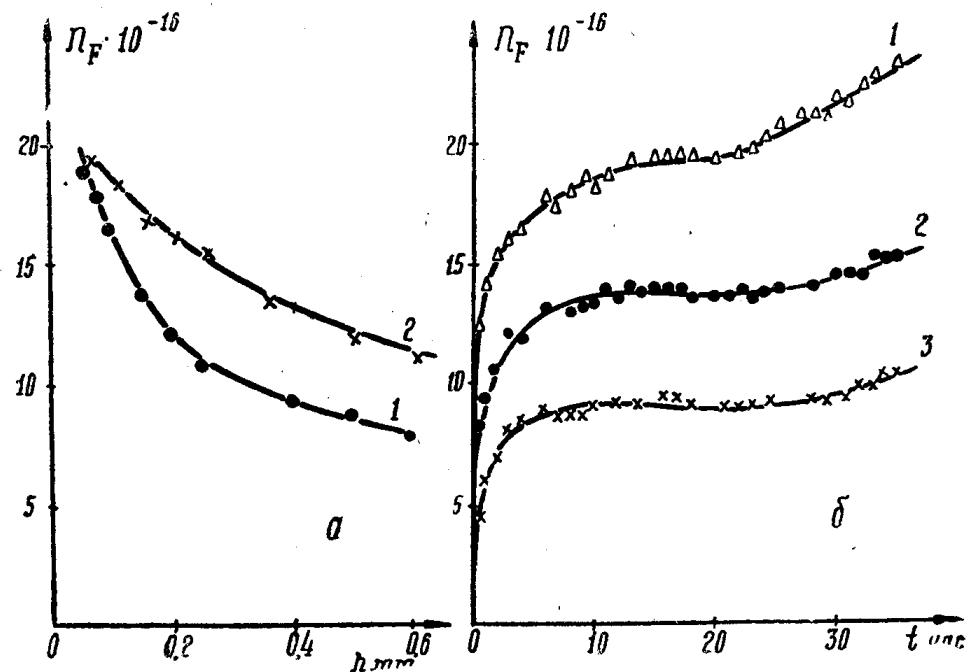


Рис. 2. *a*—кривые зависимости концентрации F -центров от глубины микрослоя кристалла KCl, облученного рентгеновыми лучами от трубы с медным (1) и молибденовым (2) анодом; *б*—кинетические кривые накопления F -центров в кристалле KCl на расстоянии 0,07 (1); 0,3 (2) и 0,7 (3) мм от облучаемой поверхности

На данной установке были получены кривые накопления F -центров в кристалле KCl на глубине 0,07; 0,3 и 0,7 мм от края кристалла (рис. 2, б; кривые 1, 2 и 3 соответственно). Рентгеновская трубка с Mo-анодом, 14 ma , 42 kV . Кинетические кривые накопления центров окраски в щелочногалоидных монокристаллах могут быть получены для микрослоев, находящихся на любом расстоянии от облучаемой поверхности.

Автор выражает благодарность И. Я. Мелик-Гайказян за руководство настоящей работой.

ЛИТЕРАТУРА

1. I. L. Mador, R. F. Wallis, W. C. Williams, R. C. Herman. Phys Rev. **96**, 617—628, 1954.
2. P. Mitchell, D. Wiegand, R. Smoluchowsky. Phys. Rev. **121**, 484, 1961.
3. E. Abramson и M. E. Caspari. Phys. Rev. **129**, 536, 1963.